09

Оценка электрооптики сегнетокерамики цирконата-титаната свинца ЦТС и ЦТСЛ по измерению модуляции отражения света

© А.В. Князьков

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 195251 Санкт-Петербург, Россия e-mail: akniazkov@mail.ru

(Поступило в Редакцию 5 сентября 2014 г. В окончательной редакции 7 июля 2015 г.)

Оценены электрооптические коэффициенты изменения показателя преломления сегнетофкерамики цирконата-титаната свинца ЦТС и ЦТСЛ, индуцированного переменным электрическим полем по измерению модуляции отраженного света. Проведено сравнение значений электрооптического коэффициента ЦТСЛ керамики, полученного традиционным способом исследования двулучепреломления — по набегу фазы света при пропускании света и новым методом двулучеотражения — по модуляции отражения света.

Индуцированное изменение показателя преломления δn под действием электрического поля *E* в неполяризованных сегнетокерамических материалах описывается квадратичным электрооптическим (ЭО) коэффициентом *R*, а для поляризованных образцов — описывается линейным ЭО коэффициентом *r*:

$$\delta n_R = \frac{1}{2} n^3 R E^2,$$

$$\delta n_r = \frac{1}{2} n^3 r E.$$
 (1)

Измерение ЭО коэффициентов сред, как правило, основывается на методах определения индуцированной полем разности фазовых задержек ортогонально поляризованных световых волн, прошедших среду, помещенную в различные интерферометрические схемы [1]. Наиболее популярной схемой исследования электрооптики является пропускающая поляризационно-оптическая схема (ПОС) (рис. 1) [2,3]. Эти известные методы применимы для прозрачных ЭО сред достаточной толщины, позволяющей достичь у прошедших пучков измеримой разности фазовых задержек. Разрабатываемые ЭО среды не всегда обладают достаточной прозрачностью и часто синтезируются в виде пленок. Исследование таких сред сталкивается с определенными трудностями изза малого пропускания и толщины. Это стимулирует разработку новых методов исследования электрооптики. Реализации метода исследования электрооптики по измерению модуляции отраженного света посвящена настоящая работа.

Необходимое для измерения ЭО коэффициента преобразование фазовой модуляции в амплитудную в ПОС со скрещенными анализатор-поляризатором описывается выражением

$$I = I_0 \sin^2\left(\frac{\Gamma}{2}\right),\tag{2}$$

где I_0 — интенсивность света, падающего на среду, I — интенсивность света, прошедшего среду, Γ — разность фазовых задержек ($\Gamma = 2\pi l \delta n / \lambda$, l — толщина среды, λ — длина волны света).

Преобразование фазовой ЭО модуляции в амплитудную модуляцию без применения интерферометрических схем и поляризационно-оптических схем с поляризатором-анализатором, продемонстрировано в нашей работе [4]. Где предложена отражающая схема, в которой преобразование фазового изменения показателя преломления в амплитудное изменение интенсивности отраженного света осуществляется в соответствии с законом Френеля.

В настоящей работе проведена оценка ЭО коэффициентов как прозрачной сегнетокерамики цирконататитаната свинца, модифицированной лантаном (ЦТСЛ x/65/35, x — содержание лантана в at.%: 8, 9 и 10, 65/35 — отношение цирконий-титан) так и непрозрачной поляризованной сегнетокерамики ЦТС-19 $((Pb_{0.95}Sr_{0.05})(Zr_{0.53}Ti_{0.47})O_3 + 1 wt.\% Nb_2O_5)$ по измерению изменений коэффициента отражения поляризованного света, вызванного модуляцией показателя преломления среды под действием низкочастотного переменного электрического поля. В отличие от методов ПОС измеряется не разность фазовых задержек ортогонально поляризованных волн, прошедших ЭО среду, а измеряется разность коэффициентов отражения для этих волн, вызванная изменением показателя преломления среды. Известные методы измерения ЭО коэффициентов



Рис. 1. Поляризационно-оптическая пропускающая схема исследования электрооптики прозрачных материалов.

используют эффект индуцированного двулучепреломления. По аналогии с названием эффекта двулучепреломления можно назвать отражение света от ЭО материалов эффектом двулучеотражения. Методика нашей работы основана на измерении изменения индуцированного двулучеотражения.

Коэффициент отражения света ρ , нормально падающего на границу раздела диэлектрической среды с показателем преломления *n*, определяется, согласно закону Френеля, следующим выражением:

$$\rho = \frac{I_{\rho}}{I_0} = \frac{(n-1)^2}{(n+1)^2},\tag{3}$$

где *I*_{*ρ*} — интенсивность отраженного света.

Изменение коэффициента отражения $\delta \rho$ ЭО сред под действием внешнего электрического поля для нормального падения света, учитывая (1) и (3), можно записать

$$\delta \rho_R = \frac{\delta I_{\rho}}{I_0} = \frac{\partial \rho}{\partial n} \,\delta n_R = 2 \,\frac{n-1}{(n+1)^3} \,n^3 R_{\text{eff}} E^2,$$

$$\delta \rho_r = \frac{\delta I_{\rho}}{I_0} = \frac{\partial \rho}{\partial n} \,\delta n_r = 2 \,\frac{n-1}{(n+1)^3} \,n^3 r_{\text{eff}} E, \qquad (4)$$

где n — показатель преломления, равный либо n_0 для обыкновенно поляризованной волны, либо n_e для необыкновенно поляризованной волны, определяемый ориентацией плоскости поляризации падающей волны, $R_{\rm eff}$ и $r_{\rm eff}$ — эффективный квадратичный и соответственно линейный ЭО коэффициент.

Изменение коэффициента отражения под действием переменного электрического поля $E = E_0 \sin(\omega t)$ $(\omega = 2\pi f, f - - частота)$ с амплитудой E_0 в неполяризованных сегнето-керамических средах можно записать

$$\delta \rho_{R} = \frac{\delta I_{\rho}}{I_{0}} = 2 \frac{n-1}{(n+1)^{3}} n^{3} R_{\text{eff}} E^{2} = k R_{\text{eff}} E_{0}^{2} \sin^{2}(\omega t)$$
$$= \frac{k R_{\text{eff}} E_{0}^{2}}{2} \left(1 - \cos(2\omega t)\right), \tag{5}$$

где $k = 2(n-1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^3$.

Откуда из-за квадратичной зависимости амплитуд второй гармоники изменения коэффициента отражения (или изменения показателя преломления) от амплитуд поля можно определить эффективный квадратичный ЭО коэффициент.

На рис. 2 показана схема экспериментальной установки. Источником света служил полупроводниковый лазер с удвоением частоты излучения 3 (лазерный модуль DPSS: модель TD-GP (100 mW) с длиной волны излучения 532 nm). Мощность излучения основного пучка регулировалась при помощи поляризатора 4. Плоскость поляризации пучка для соответствия необыкновенному показателю преломления ориентировалась перпендикулярно полю в образце поляризатором 5. Пучок проходил через полупрозрачное зеркало 6 и по нормали падал на образец 1 в зазор между планарными электродами 2.



Рис. 2. Схема экспериментальной установки исследования электрооптики материалов по нормальному отражению поляризованного света.



Рис. 3. Осциллограммы сигналов отраженной интенсивности света (сплошная кривая) и прикладываемого электрического поля (штриховая) в случае: *а* — линейного и *b* — квадратичного ЭО эффектов.

После отражения от поверхности образца *1* пучок отражался полупрозрачным зеркалом *6* и через собирающую рассеянный свет линзу 7 попадал на фоторегистрирующий датчик *8* (фотодиод с трансимпедансным усилите-

лем ОРТ101). Сигнал датчика подавался на селективный усилитель 9 (нановольтметр Unipan 233) и регистрировался двухканальным USB-осциллографом либо на второй гармонике в случае квадратичного ЭО эффекта, либо на первой гармонике — линейного ЭО эффекта (рис. 3). Регистрация и обработка данных осуществлялась РС компьютером 10. На планарные электроды 2 образца 1 подавалось высоковольтное переменное напряжение от трансформатора 12, первичная обмотка которого подключена к задающему генератору низкой частоты (f = 80 Hz) 11. Высоковольтное напряжение V в процессе измерений плавно увеличивалось до 3.5 kV и затем плавно уменьшалось. Чтобы снизить влияние наводок, измерительная ячейка с образцом, фотодатчик и высоковольтный трансформатор тщательно экранировались.

ЦТСЛ и ЦТС сегнетокерамика в отсутствии электрического поля является изотропной средой, а поле вызывает анизотропию, проявляющуюся в эффекте наведенного двулучепреломления. В этих материалах под действием внешнего электрического поля происходит деформация усредненной оптической индикатрисы показателя преломления, и она становится эллипсоидом с оптической осью, направленной по полю.

Исследовались наиболее популярные составы ЦТСЛ керамики: x/65/35 (x = 8, 9 и 10) ЦТС-19. Прикладываемое электрическое поле создавалось планарными электродами на полированной поверхности образцов и соответствовало поперечной геометрии по отношению к направлению падающего и отраженного света. Измеряемый пучок отражался от центральной части между этими электродами. Максимальная напряженность электрического поля в этом месте на поверхности образца определяется размерами электродов и межэлектродного пространства *d* [6,7] и приближенно считалась равной 0.63V/*d*. На рис. 3 показаны осциллограммы управляющего поля и изменений отраженной интенсивности в случае линейного (первая гармоника) и квадратичного (вторая гармоника) ЭО эффектов.

На рис. 4, *а*-*с* показаны зависимости индуцированного изменения показателя преломления в ЦТСЛ керамике составов 8/65/35, 9/65/35 и 10/65/35, рассчитанные на основании измеренных изменений коэффициента отражения света. На основании этих зависимостей были определены соответствующие эффективные электрооптические коэффициенты $R_{\rm eff}$. Для ЦТСЛ керамики состава 8/65/35 $R_{\rm eff} = 2.5 \cdot 10^{-15} \, {\rm m}^2/{\rm V}^2$, для керамики состава 9/65/35 $R_{\rm eff} = 3.7 \cdot 10^{-16} \, {\rm m}^2/{\rm V}^2$. Полученные значения ЭО коэффициентов находятся в хорошем согласии с литературными данными [8,9].

С целью определения достоверности ЭО измерений с помощью отражательной методики проводилось сравнительное измерение значений ЭО коэффициента ЦТСЛ керамики состава 9/65/35, полученных новым отражательным методом (рис. 2) и обычной пропускающей ПОС методикой (рис. 1). В силу планарной геометрии электродов поперечная компонента электрического поля



Рис. 4. Зависимости индуцированного изменения показателя преломления сегнетокерамики ЦТСЛ от величины электрического поля для составов: *a* — 8/65/35, *b* — 9/65/35 и *c* — 10/65/35.

E_y уменьшается по мере прохождения светового пучка через образец по оси *Z* и при достаточно широких электродах приближенно описывается формулой [6,7]

$$E_{y}(0,z) = \frac{2V}{\pi d} \left(1 + \frac{4z^{2}}{d^{2}}\right)^{-1/2}.$$
 (6)

Тогда разность фазовых задержек Г будет определяться как

$$\Gamma = \frac{\pi}{\lambda} n^3 R \int_0^l E_y^2 dy.$$
 (7)

Из последнего выражения с учетом выражения (2) по измерениям изменений интенсивности ПОС определялся ЭО коэффициент: $R_{\rm eff} = 4 \cdot 10^{-16} \, {\rm m}^2/{\rm V}^2$. Результаты



Рис. 5. Зависимость индуцированного изменения показателя преломления сегнетокерамики ЦТС-19 от величины электрического поля.

сравнительных измерений показали хорошее соответствие значений ЭО коэффициентов.

Необходимо отметить высокую чувствительность измерений электрооптики среды при помощи отражательной методики в случае слабых модуляций показателя преломления. В пропускающем методе ПОС регистрируемый сигнал, как видно из (2), пропорционален $(\delta n)^2$ (заметим $\delta n \ll 1$), тогда как в отражательном методе сигнал пропорционален δn (4).

Наиболее важным применением отражательной методики измерения электрооптики является исследование непрозрачных ЭО сред. Для демонстрации этого преимущества было проведено исследование ЭО коэффициента непрозрачной сегнетокерамики ЦТС-19. Коммерческие образцы керамики ЦТС-19 поляризуются в процессе изготовления, поэтому в отличие от ЦТСЛ керамики они обладали линейным ЭО эффектом.

На рис. 5 показана зависимость индуцированного изменения показателя преломления в ЦТС-19 керамике, рассчитанная по измеренным изменениям коэффициента отражения света. На основании этой зависимости был определен линейный электрооптический коэффициент $r = 1.6 \cdot 10^{-9}$ m/V. Это значение одного порядка с линейным ЭО коэффициентом для пленки ЦТСЛ керамики состава 7/30/70 ($r = 3.17 \cdot 10^{-9}$ m/V) [10].

Таким образом, в настоящей работе реализован метод оценки ЭО коэффициентов ЦТСЛ сегнетокерамики составов 8–10/65/35 и ЦТС-19 по измерению модуляции отраженного света под действием переменного электрического поля. Техническая реализация метода оказалась достаточно проста и не требовала использования сложной поляризационно-оптической интерференционной системы, которая применяется в обычных ЭО методиках. Данный отражательный метод может быть использован для экспрессоценки электрооптики поглощающих ЭО сред.

Список литературы

- [1] Aillerie M., Théofanous N., Fontana M.D. // Appl. Phys. B. 2000. Vol. 70. P. 317.
- [2] Мустель Е.П., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света. М.: Наука, 1970. 296 с.
- [3] Сонин А.С., Василевская А.С. Электрооптические кристаллы. М.: Атомиздат, 1971. 328 с.
- [4] Князьков А.В. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2013. Т. 182. № 4–1. С. 100–104.
- [5] Kniazkov A.V. // Appl. Phys. B. 2015. Vol. 118. N 2. P. 231– 234.
- [6] Kaminov I.P., Stulz L.W., Turner E.H. // Appl. Phys. Lett. 1975. Vol. 27. N 10. P. 555–557.
- [7] Кондилснко И.И., Коротков П.А., Фелинский Г.С. // Укр. физ. журн. 1979. Т. 24. № 9. С. 1270–1278.
- [8] Камзина Л.С., Ruan W., Li G., Zeng J. // ФТТ. 2012. Т. 54. Вып. 10. С. 1899–1904.
- [9] Rouchon J.M., Micheron F. // Czech. J. Phys. B. 1975. Vol. 25.
 P. 575–584.
- [10] Lin J.-F., Jeng J.-S., Chen W.-R., Wu B.-H. // Optik. 2012. Vol. 123. P. 276–279.